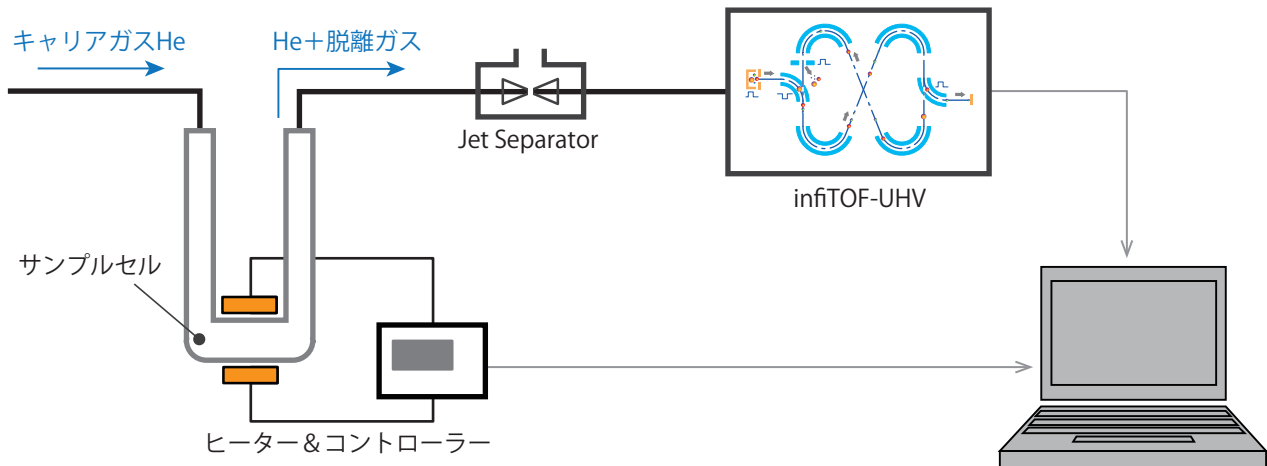


材料を加熱した際に材料から脱離する、あるいは熱分解により生成するガスの挙動を解析することにより、材料へのガス吸着・化学吸着の状態や材料の熱特性を把握することが可能です。この分析を昇温脱離法 (Temperature Programmed Desorption: TPD) といひ、例えば精密エレクトロニクス材料や固体触媒の開発において有用な情報をもたらします。脱離ガスを質量分析する手法をTPD-MSといひ、一般に質量分析計には四重極型質量分析計 (QMS) が用いられています。



マルチターン方式飛行時間型質量分析装置infiTOFは、低分子量域での優れた感度と質量分解能を備えています。TPD-MS分析にinfiTOF-UHVを用いることで、**QMSでは質量分離できない同整数質量の低分子ガス成分を個別に精密質量解析**ことができ、従来にない精密な昇温脱離ガスの挙動把握が可能になります。

